

Q-12

스핀 터널링 접합에서 열처리 온도에 따른 자기적 특성 변화

송실대학교 강재구*, 박승영, 최연봉, 조순철

Variations of magnetic characteristics of spin tunneling junctions with annealing temperature

Soongsil University J. Kang*, S. Park, Y. Choi, S. Jo

1. 서론

TMR 현상은 20 % 이상의 높은 자기저항비와 작은 포화자계등 다른 자기저항 재료보다 우수한 특성이 있다. 이러한 우수한 특성 때문에 최근에는 자기헤드, 자기센서와 MRAM 등의 소자용 등에 많은 연구가 이루어지고 있다. 이러한 소자 제조과정에는 온도 변화에 따른 소자의 특성 변화가 발생할 수 있다. 따라서 열적 안정도와 온도효과에 따른 접합에서의 특성 변화등이 활발히 연구되고 있다[1,2,3,4].

본 연구에서는 substrate/Ta(50Å)/NiFe(110Å)/FeMn(150Å)/NiFe(60Å)/CoFe(20Å)/Al₂O₃(16Å)/CoFe(20Å)/NiFe(450Å) 구조에서 진공 중 열처리를 하여 온도에 따른 특성변화를 연구하였다.

2. 실험방법

Perkin-Elmer 2400 스퍼터 장비(4 inch 타겟 5 개 장착)를 사용하여 초기 진공도 4.0×10^{-7} Torr 이하에서 DC 마그네트론 방법으로 터널링 접합을 증착하였다. 기판은 2,000Å 두께의 산화막이 존재하는 Si 웨이퍼를 1 inch × 1 inch 크기로 잘라 사용하였다. 기판주위에는 영구자석을 배치하여 박막의 이방성을 형성시켰다. 터널링 접합은 금속마스크를 사용하여 십자형으로 형성하였으며 접합부분의 크기는 200μm × 200μm, 200μm × 1,000μm, 1,000μm × 1,000μm 이다. 이중 200μm × 1,000μm 영역은 긴축이 외부자장과 나란한 경우와 수직인 경우 두 가지가 있으며 이 네가지 구조가 하나의 기판위에 증착할 수 있도록 고안하였다. 열처리는 스퍼터 내부에 장착되어 있는 가열기를 이용하였고 온도는 80°C, 120°C, 150°C, 180°C 까지 변화를 주었다. 이때에 시편 주위에 영구자석을 배치하여 약 250 Oe 의 자장을 박막 증착시 가해준 방향으로 인가하였다. 열처리시간은 1 시간이었고 실온까지 서서히 냉각 한 후 4 탐침법을 이용하여 자기저항비를 측정하였다.

3. 실험결과 및 고찰

열처리 과정 중 200μm × 1,000μm 영역에서만 180°C 까지 자기적 특성을 측정할 수 있었고 나머지 크기의 영역에서는 전과정에서 이미 터널 접합구조가 파괴되어 측정이 불가능하게 되었다. Fig. 1 은 200μm × 1,000μm 크기의 접합 영역에서 열처리 온도 변화에 따른 자기저항비 변화의 결과이다. 열처리 전 21.2 % 의 자기저항비가 180 °C 열처리 후 15.9 % 까지 감소하였으며 Fig. 2 는 본 연구에서 열처리한 접합 구조에서 측정한 자기저항비를 전체적으로 나타낸 것이다. Fig. 2 에서 볼 수 있듯이 열처리 온도가 증

가함에 따라 자기저항비는 서서히 감소하다가 180 °C에서 급격히 감소하는 것을 볼 수 있다. Fig. 3은 열처리 온도 변화에 따른 H_{ex} 값의 변화의 결과이다. 열처리 전 50 Oe에서 점차 증가하여 180 °C 열처리 후 78.9 Oe 까지 증가하는 것을 볼 수 있다. Fig. 4는 열처리 온도에 따른 터널링 접합 구조에서 자유층과 고착층의 스핀 배열이 평행일 경우와 반 평행일 경우의 저항차이이다. 온도가 증가함에 따라 열처리 전 약 500 Ω 정도의 저항값이 180 °C 열처리 후 점차 증가하여 2,000 Ω 이상까지 증가함을 볼 수 있다.

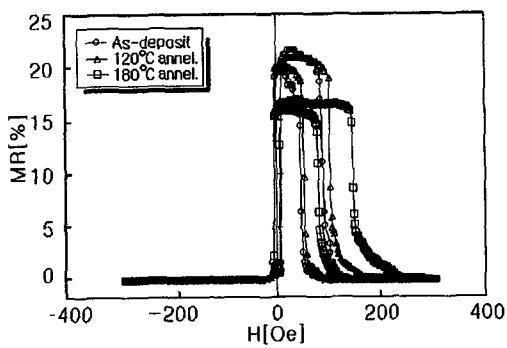


Fig. 1. RH curves at various annealing temperatures.

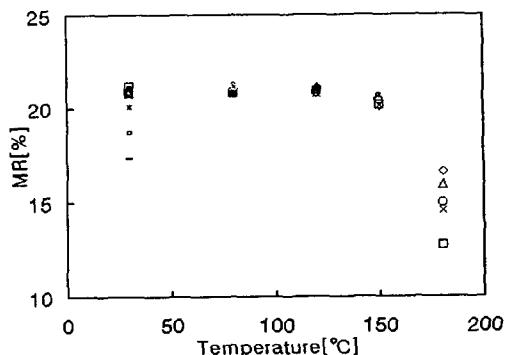


Fig. 2. Annealing temperature dependance of TMR.

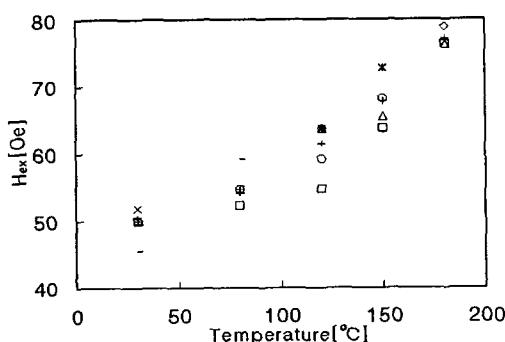


Fig. 3. Annealing temperature dependance of H_{ex} .

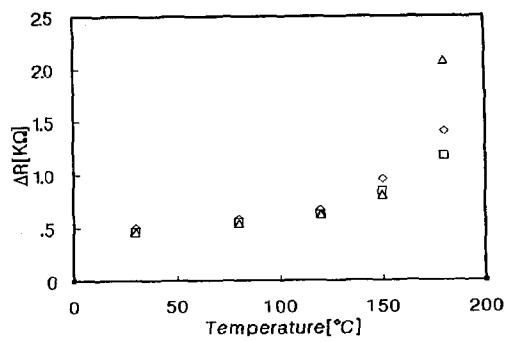


Fig. 4. Annealing temperature dependance of ΔR ($R_{max} - R_{min}$).

4. 참고문헌

- [1] S. Kumagai, N. Tezuka, and T. Miyazaki, Jpn. J. Appl. Phys., 36, L1498 (1997).
- [2] G. Choe, and S. Gupta, Appl. Phys. Lett., 70(13), 1766 (1997).
- [3] M. Sato, H. Kikuchi, and K. Kobayashi, J. Appl. Phys., 83(11), 6691 (1998).
- [4] R. C. Sousa, J. J. Sun, V. Soares, and P. P. Freitas, J. Appl. Phys., 85(8), 5258 (1999).